电场诱导直接生长碳纳米管技术研究

陆群旭,董长昆*,祝 维

(温州大学 微纳结构与光电器件研究所,浙江 温州 325035)

摘要:本文将电场诱导与热化学气相沉积(CVD)直接生长技术相结合,在合金基底上得到了垂直排列的多壁碳 纳米管(MWNT)薄膜,MWNT直径约50 nm、长度约2~3 μm。施加电场生长的MWNT的晶体性优于未加电场生长的MWNT,它们的拉曼光谱中D峰与G峰强度比值 *I*₀/*I*_c平均值分别为0.76和0.87。垂直排列的MWNT与随机排列的 MWNT的开启电场分别为3.0 V/μm和3.8 V/μm;在相同的测试电场下,前者有更高的场发射电流密度,低电流发射稳定性良好,但是MWNT相对密集,电场屏蔽效应较强。采取措施进一步调节MWNT的间距,将有助于提升发射电流密度。

关键词:多壁碳纳米管;化学气相沉积;垂直排列;场发射 中图分类号:0484.1 文献标志码:A DOI:10.3969/j.issn.1006-7086.2021.05.003

文章编号:1006-7086(2021)05-0423-07

Study on Direct Growth of Carbon Nanotubes Induced by Electric Field

LU Qunxu, DONG Changkun^{*}, ZHU Wei

(Institute of Micro-nano Structures & Optoelectronics, Wenzhou University, Wenzhou 325035, Zhejiang, China)

Abstract: In this paper, the electric field is applied in the direct Chemical Vapor Deposition (CVD) growth of CNTs to obtain vertically arranged multi-walled carbon nanotube (MWNT) films on alloy substrates. The diameter of the MWNT is about 50 nm and the length is about $2 \sim 3 \mu m$. The crystallinities of the MWNTs are better than those grown without electric field, and the average ratios of Raman spectrum D peak to G peak intensities I_D/I_G are 0.76 and 0.87, respectively. Compared with randomly arranged carbon nanotubes, the vertically aligned carbon nanotubes obtained in this work exhibit higher field emission current densities under the same electric field, and the turn-on electric fields are 3.0 V/µm and 3.8 V/µm, respectively. The aligned MWNT emitters presented good emission stability in low emission level, but the dense MWNT distribution result in high electric field shielding effect. Therefore, further attempts to adjust the MWNT spaces will be helpful to increase the emission current density.

Key words: multi-walled carbon nanotube; chemical vapor deposition; vertical alignment; field emission

0 引言

由于独特的结构特征和优越的物理、化学等性质,碳纳米管(CNT)在场电子发射、能源电池等许多领域得到了广泛的研究和应用。CNT可以通过化学 气相沉积(CVD)、电弧放电、激光烧蚀等方法制备, 而CVD法可以在导电基底上原位生长CNT薄膜,在 场发射阴极的制备中得到广泛应用。电场在CNT生 长中具有导向作用^[1],但定向生长要在一定的条件下 才能实现。Zhang等^[2]的实验证实,如果不能实现悬 空生长,CNT受到基底范德华力的作用,将失去对电 场的响应,得不到定向结构。采用等离子体增强化 学气相沉积(PECVD)可以得到定向性较好的垂直

收稿日期:2021-04-28

LU Q X, DONG C K, ZHU W. Study on direct growth of carbon nanotubes induced by electric field[J]. Vacuum and Cryogenics, 2021,27(5):423-429.

基金项目:国家自然科学基金(61620106006、61871292)

作者简介:陆群旭,硕士研究生,主要从事低维材料研究。E-mail:3532999898@qq.com。

通信作者:董长昆,教授,主要从事纳米材料器件研究。E-mail:dck@wzu.edu.cn。

引用本文:陆群旭,董长昆,祝维.电场诱导直接生长碳纳米管技术研究[J].真空与低温,2021,27(5):423-429.

排列CNT,但是PECVD系统复杂,垂直生长需要对多 个电场参数及温度、催化剂等条件进行精确控制。 Chhowalla等¹³的实验发现,生长温度过高会影响CNT 的定向性。热CVD技术系统简单、生长过程易于控 制,可以制备晶体性好、直径大、具有较高场发射电流 密度的CNT样品^[4-14]。本实验室发展了在含催化剂 的合金基底上直接生长MWNT的热CVD技术,可以 制备不同尺度的MWNT阴极。直接生长的MWNT与 基底的结合力强、接触电阻小,有利于提高场发射寿 命^[15]。定向排列可以较好地发挥CNT长径比的优 势,提升场增强因子,进而降低场发射场强。

本工作将热CVD直接生长与电场诱导相结合, 期望在合金基片上制备出直径为几十纳米、长度达 数个微米的垂直排列MWNT薄膜场发射阴极,提升 MWNT 阴极的发射场强和电流稳定性能,希望有助于直接生长 CNT 的场发射技术应用。

1 实验方法

制备垂直排列 MWNT 阴极的实验装置如图 1 所示。通过上下两个 Si 片(单面镜面抛光 p 型单晶 Si, 电阻率为 0.001~0.009 Ω ·cm,厚度为 525 μ m)电极 施加电场,将哈氏合金基底放置于下方 Si 片抛光面 中心处,上下 Si 片间距约 1 mm。之后对沉积室抽 气至约4 Pa 后开始加热,40 min 后通入 Ar 气,至 750 ℃后通入乙炔(Ar 流量 34.3 mL/min,乙炔 (C₂H₂)流量 141 mL/min),同时开启直流电源(电 压范围为 0~5 000 V),生长结束后立即关闭电源与 乙炔,继续通入 Ar,待样品冷却至室温后取出。





Fig. 1 Schematic diagram of experimental device for growing vertically aligned carbon nanotubes

利用扫描电子显微镜(SEM,日本JSM-7100F) 对 MWNT 的表面形貌进行表征,并将合金片从中间 处剪开,从剪切侧面研究 MWNT 的定向性与附着特 征。将本实验中生长的合金片上的 MWNT 刮下溶 解在乙醇溶液中,之后在铜网栅极上滴加 MWNT 乙 醇溶液,烘干后使用透射电子显微镜(TEM,JEM-2100F)观察 MWNT 更高分辨率结构。采用拉曼光谱 (DXR3 Raman 532 nm)表征 MWNT 的晶体性。

在超高真空系统中进行 MWNT 阴极材料的场 发射性能测试。真空获得设备包括安捷伦(TS-300) 无油机械泵、中科科仪(FF-100/110)分子泵。场发射 测试采用吉时利(MODEL 248)高压电源和Victor 86E 电流表,测试前在300℃下对系统进行烘烤除气10 h, 测试前系统压力为10⁻⁷ Pa数量级。首先对样品进行 2个电流-电压循环除气老练,随后进行场发射电流 密度-电场(J-E)性能和稳定性测试。测试采用二级 式结构,阳极为304不锈钢,与MWNT阴极表面间距 为300 μm,阴极材料的有效场发射面积为16 mm²。

2 实验结果与分析

电场与生长时间对 MWNT 形貌的综合影响如 图 2 所示。图 2(a)、(b)表明,在其他条件相同的情况下,未加电场生长的 MWNT 呈随机排列,加电场 生长的 MWNT 呈垂直排列。SEM 结果显示,气压固

定为1×10³ Pa,当改变生长过程中通入乙炔的时间, 增加生长时间时,MWNT的取向性会逐渐衰弱,其 中生长时间为5 min与6 min的取向性较好。

研究了更高场强对 MWNT 生长的影响,当生长 压力为 1×10³ Pa,生长时间为5 min,分别施加100 V/ mm、500 V/mm、1 000 V/mm和1 500 V/mm的场强时, MWNT的SEM照片如图3所示。100 V/mm条件下生长效果最好, MWNT数量多, 排列紧密, 长度长, 直径小; 500 V/mm、1 000 V/mm和1 500 V/mm条件下只能得到排列稀疏、粗短的MWNT。



Fig. 3 SEM morphologies of MWNT grown under different electric field intensity

从图 3(a)中可以看出,100 V/mm 条件下生长 出的 MWNT 为垂直排列状,长度达到约2 μm,直径 约为 50 nm。Liao 等^[16]在铜片上涂抹二茂铁乙醇溶 液,烘干后在热 CVD 中生长的"牛乳头"形状的亚微 米-纳米碳异构结构长度仅为 300 nm 以内。Avigal 等^[17]采用电子束蒸发方式,在Si片上沉积钴催化剂后 在热 CVD 中生长的 MWNT 平均直径达到了 80 nm, 长度只有 400 nm。大长径比的垂直 MWNT 在场发 射过程中会有更大的场增强因子,因此,从长径比 的角度考虑,本研究中生长的 MWNT 更加有利于场 发射。另外必须指出的是,100 V/mm低场强下Ar 与乙炔未发生电离;500 V/mm以上场强下生长结 束后镜面抛光的Si片表面会出现部分黑色区域,表 明气体发生了电离放电,离子轰击基片,限制了 MWNT的自由生长,在绝大部分区域上只能得到一 些直径粗、长度短的MWNT。

高分辨率TEM照片表明,未加电场与加电场生 长的均为MWNT,MWNT的顶端有催化剂颗粒,管 身表面也有少量催化剂颗粒,加电场生长的MWNT 更加平直,如图4所示。



图 4 MWNT的高分辨率 TEM 显微照片 Fig. 4 High resolution TEM micrograph of MWNT

对于加电场条件下 CNT 的生长机制至今仍有 争议,本论文尝试从库仑排斥力的角度进行解释。 Liu 等^[18]报道了 MWNT 的功函数 φ_{MWNT} 为4.7~4.9 eV, 直径和壁的数量对其没有明显的影响。Masashi 等^[19] 报道的 MWNT 的功函数为4.95 eV。本研究采用的 合金片的功函数 $\varphi_{Ni,Gr}$ 为4.6 eV。MWNT为顶端生长 模式,即在合金片上的微纳凸起(催化剂)处生长。 MWNT生长过程中,由于 $\varphi_{Ni,Cr} < \varphi_{MWNT}$ (金属催化剂的 费米能级 $E_{fni,Cr}$ 高于MWNT的费米能级 E_{MWNT}),催化 剂中的电子被驱动到MWNT中,如图5(b)所示。因此, MWNT顶端的催化剂带正电,MWNT管体带负电。催 化剂在外加电场作用下与带正电的合金片相互排斥, 受到一个向上的库仑排斥力F,脱离合金片,成为 "催化剂颗粒",带着MWNT向上生长,如图5(c)所示。



Fig. 5 Growth mechanism of MWNT with electric field

对加电场与未加电场 MWNT 样品的晶体性进行的拉曼分析如图 6 所示。MWNT 的 D 峰与 G 峰分别位于拉曼光谱的 1 360 cm⁻¹和 1 584 cm⁻¹处。G 峰是石墨晶体的基本振动模式, D 峰对应 MWNT 的缺陷结构。D 峰与 G 峰强度的比值 *I_p/I_c* 可以反映 MWNT 的缺陷程度。表 1 为两组各四个样品的拉曼

 $I_{\rm D}/I_{\rm c}$ 比值,可以看出,两种条件下MWNT样品的晶体 性均较为良好, $I_{\rm D}/I_{\rm c}$ 比值均小于1。其中加电场生长 的 MWNT($I_{\rm D}/I_{\rm c}$ 平均值为0.76)的晶体性要优于未 加电场生长的 MWNT($I_{\rm D}/I_{\rm c}$ 平均值为0.87)。这可能 由于在电场的作用下,乙炔裂解后形成的碳离子排 布更加有序,从而提升了 MWNT的晶体性。



表1 拉曼谱对比 Tab.1 Raman comparison



研究中对加电场和不加电场 MWNT 样品的场 发射性能进行了测试比较,如图7所示。由于 MWNT 在首次场发射过程中会受到气体吸附的影 响,所以图中 J-E 曲线均选自于接近本征发射的第 三次测试。从图中可以看出,在相同的测试电场强 度下,垂直排列的 MWNT 会有更大的电流密度,它 们的开启电场分别为 3.0 V/μm 和 3.8 V/μm。CNT 薄膜的密度、长度、间距也会影响其场发射性能。 Nilsson 等^[20]的研究表明,当CNT 的密度太小时,由 于发射位点太少,实际的宏观发射电流密度就会很 小。当CNT密度太大时,相邻的CNT会由于场屏蔽 效应而产生干扰,降低CNT的场增强因子,从而降 低发射电流密度。实验指出,当CNT之间的距离为 CNT长度的两倍时,得到的发射电流密度为最大 值。因此,后期如果能够控制MWNT的间距,将会 进一步提高定向MWNT样品的发射性能。

图8为不同样品的场发射稳定性测试对比。对 于无电场生长的样品,在2800 V测试电压下,初始 2h电流下降显著,2~22h期间稳定性较好,但波动 范围大于加电场生长样品。对于100 V/mm条件下 生长的样品,在同样的测试电压下,2~22h测试期 间始终保持良好的稳定性,且电流密度的波动小于 4%。因此加电场生长的定向MWNT的发射稳定性 优于未加电场的MWNT,这可能是由于定向排列样 品在发射过程中基本维持MWNT的高度所致。







图 8 场发射稳定性比较曲线 Fig. 8 Emission stability comparison

4 结论

(1)将阳极化工艺与在金属基底上直接生长技术相结合,利用电场诱导直接在合金片上制备出直径约50 nm、长度2~3 μm的垂直排列 MWNT薄膜。

(2)加电场生长的 MWNT 的 $I_{\rm D}/I_{\rm c}$ 平均值为 0.76, 未加电场生长的 MWNT 的 $I_{\rm D}/I_{\rm c}$ 平均值为 0.87,前者 的晶体性优于后者。

(3) 在相同的测试电场强度下,垂直排列的 MWNT 阴极的发射电流密度高于随机取向的 MWNT 阴极。它们的开启电场分别为3.0 V/µm和 3.8 V/µm。由于基本维持 MWNT 的高度(长度),垂 直排列 MWNT 的发射稳定性优于随机取向 MWNT。

总之,电场诱导生长有利于改进CNT的场发射

性能,对研制高性能CNT场发射阴极器件具有积极 意义。

参考文献:

- MATTHEW T C, VITO C, WILLIAM I M. Horizontal carbon nanotube alignment[J]. Nanoscale, 2016, 8(35): 15836–15844.
- [2] ZHANG Y G, CHANG A, CAO J, et al. Electric-field-directed growth of aligned single-walled carbon nanotubes[J]. Applied Physics Letters, 2001, 79(19):3155–3157.
- [3] CHHOWALLA M, TEO K B K, DUCATI C, et al. Growth process conditions of vertically aligned carbon nanotubes using plasma enhanced chemical vapor deposition[J]. Journal of Applied Physics, 2001, 90(10): 5308–5317.
- [4] BAGHGAR M, ABDI Y, ARZI E. Effects of magnetic and elec-

tric fields on the growth of carbon nanotubes using plasma enhanced chemical vapor deposition technique[J]. The European Physical Journal – Applied Physics , 2009 , 48(2):429–452.

- [5] BAO Q L, PAN C X. Electric field induced growth of well aligned carbon nanotubes from ethanol flames[J]. Nanotechnology, 2006, 17(4):1016-1021.
- [6] YANG X H, MA H I, ZENG F G. Observation of field emission from carbon nanoparticles film coating on top of vertically aligned carbon nanotubes on silicon substrate[J]. Vacuum, 2019,167:113-117.
- [7] LONE M Y, KUMAR A, HUSAIN S, et al. Growth of carbon nanotubes by pecvd and its applications: a review[J]. Current Nanoscience, 2017, 13:536–546.
- [8] MEYYAPPAN M, DELZEIT L, CASSELL A, et al. Carbon nanotube growth by PECVD: a review[J]. Plasma Sources Sci. Technol., 2003, 12: 205–216.
- [9] LANCE D, IAN M, BRETT A, et al. Growth of multiwall carbon nanotubes in an inductively coupled plasma reactor[J]. Journal of Applied Physics, 2002, 91(9):6027–6033.
- [10] TEO K B K, CHHOWALLA M, AMARATUNGA G A J, et al. Uniform patterned growth of carbon nanotubes without surface carbon[J]. Applied Physics Letters, 2001, 79 (10) : 1534– 1536.
- [11] PAL A F, RAKHIMOVA T V, SUETINB N V, et al. Effect of the electric field of the anode sheath on the growth of aligned carbon nanotubes in a glow discharge[J]. Plasma Physics Reports, 2007, 33(1):43–53.

- [12] ZHOU W W, DING L, YANG S W, et al. Orthogonal orientation control of carbon nanotube growth[J]. Journal of the American Chemical Society, 2010, 132(1):336–341.
- [13] YING X, ZUBAIR A, ZICHAO M, et al. Low temperature synthesis of high-density carbon nanotubes on insulating substrate[J]. Nanomaterials, 2019, 9(3):473.
- [14] BAO Q L, ZHANG H, PAN C X. Simulation for growth of multi-walled carbon nanotubes in electric field[J]. Computational Materials Science, 2007, 39(3):616–626.
- [15]周彬彬,张建,何剑锋.基于 CVD 直接生长法的碳纳米管 场发射阴极[J].真空,2018,55(5):10-14.
- [16] LIAO C W, ZHANG Y P, PAN C X. High-voltage electricfield-induced growth of aligned "cow-nipple-like" submicro-nano carbon isomeric structure via chemical vapor deposition[J]. Journal of Applied Physics, 2012, 112(11):114310.
- [17] AVIGAL Y, KALISH R. Growth of aligned carbon nanotubes by biasing during growth[J]. Applied Physics Letters, 2001, 78(16):2291-2293.
- [18] LIU P, SUN Q, ZHU F, et al. Measuring the work function of carbon nanotubes with thermionic method[J]. Nano Letters, 2008,8(2):647–651.
- [19] MASASHI S, MASAFUMI A. Work function of carbon nanotubes[J]. Carbon, 2001, 39(12):1913–1917.
- [20] NILSSON L, GROENING O, EMMENEGGER C, et al. Scanning field emission from patterned carbon nanotube films[J]. Applied Physics Letters, 2000, 76(15):2071–2073.

(责任编辑:任 妮)